



NINT 나노융합기술원

MOAFAB

분석 서비스 신청 가이드

INDEX

- I. 서비스 신청 방법 (P5)
- II. 장비별 신청 방법 (P14)
- III. 두 시간 이상 신청 방법 (P19)
- IV. 예약 승인 확인 방법 (P23)
- V. 예약 취소 방법 (P26)
- VI. 장비별 예약 확인 방법 (P29)
- VII. 시험분석결과서 발급 방법 (P32)

회원가입 및 로그인



모아팹 홈페이지 접속 후 회원가입 및 로그인
** 기존 NINT 사용자도 모아팹 회원가입 필수

<https://www.moafab.kr>

NINT MOAFAB 신청 방법



① 서비스 신청 방법 p5 ~ 13

② 장비별 신청 방법 p15 ~ 18

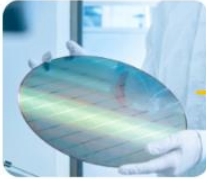
서비스 신청 방법

서비스 신청 방법 (1) - 기관/ 옵션/ 분석 서비스 신청 선택

서비스 신청

서비스 신청

Home > 펌서비스 신청 > 서비스 신청



펌서비스 안내

펌서비스를 이용하실 때에는 우선 상담을 먼저 진행하신 후, 안내에 따라 공정신청을 진행하시면 됩니다.
상담은 일반상담과 기술상담으로 구분되며, 기술 상담 이용시 소정의 수수료가 추가 될 수도 있습니다.
결제유형은 반드시 작성해 주셔야 하며, 요청한 공정에 대한 대략적인 견적서는 무료 발급 됩니다.
견적서는 대략적인 비용을 측정한 것으로 실제 청구비용과는 차이가 발생할 수 있습니다.
공정신청을 하게 되면 해당 기관 담당자의 확인 및 승인 이후부터 계속 진행하실 수 있습니다.
감사합니다.

기관선택 원하시는 기관명을 선택해주세요

☐ NNFC
나노융합기술원

☐ KANC
한국나노기술원

☒ NINT
나노융합기술원

☐ DGIST
대구경북과학기술원

☐ ISRC
서울대학교 반도체공동연구소

☐ ETRI
한국전자통신연구원

옵션선택 원하시는 옵션을 선택해주세요

☒ 신규

☐ 참조

이전 서비스 신청서 | 기술상담 | 견적서

펌서비스 신청

분석서비스 신청

① 기관선택

☒ **NINT**
나노융합기술원

② 옵션선택

☒ 신규

③ 분석 서비스 신청

분석서비스 신청

** 이후 비슷한 샘플 분석 의뢰 및 직접 사용시에는 **참조 → 이전 서비스 신청서**를 선택하시면 이전 정보를 불러올 수 있습니다.⁵

서비스 신청 방법 (2) - 신청 정보 작성

서비스 신청

 서비스 신청

Home > 펄서비스 신청 > 서비스 신청

신청 정보

신청번호		서비스 상태	
분석 신청명 *	신청명은 실험 과제명 혹은 결과물(제품)등으로 명명하거나 혹은 다르게 명명하더라도 명확하게 분류할 수 있도록 명명하여 등록하기를 권장합니다.		
지원 사업 *	일반 서비스		
시료 수탁예정일 *	2024-12-28	이용목적 *	선택
신청분야 (시료 정보) *	선택	분석분야 *	선택
신청방식 *	기관 설계	진행방법 *	선택

① 시료 수탁 예정일 : 시료가 기관에 도착할 날짜

② 신청 방식

- 기관설계 : 공정/장비 및 순서를 모두 기관에게 의뢰
- **본인설계 : 공정/장비 및 순서를 신청자가 직접 설계**

** 분석 장비를 사용을 원하시는 분들은 **본인 설계**로 신청해주세요.
본인 설계로 진행 해야지 장비 선택이 가능합니다.

③ 진행 방법

- 장비 의뢰진행 : 장비 담당자가 공정 진행
- 장비 직접사용 : 사용자가 직접 공정 진행

+) 장비 라이선스 교육을 원하는 경우
: 신청분야와 이용목적에 교육, 장비교육으로 선택

서비스 신청 방법 (3) - 분석 시료 정보/ 결제 및 수령 방법 작성

서비스 신청

 서비스 신청

Home > 웹서비스 신청 > 서비스 신청

분석 시료 정보

분석목적 *			
시료물질 *	☐ 단일물질 ☐ 복합물질		
시료 Size *	(WxWXH or Diameter & 두께 (단위))	수량 [개] *	수량을 입력해주세요.
시료상태 *			
요청사항			

결제 및 수령방법

결제 유형 *	기본소속유형-나노융합기술원	결제 방식 *	☐ 카드결제(온라인) ☐ 계좌이체 ☐ 연구비정산 ☐ 기타
연구 책임자	검색 초기화	부서	
수령 방법 *	☐ 직접수령 ☐ 택배수령 ☐ 퀵수령 (퀵수령은 자부담이 발생합니다.)		

** 결제 및 수령 방법 작성 시 유의 사항

- ① 결제 유형 : 각 기관의 정산 담당자가 있는 경우 자동으로 생성
- ② 연구 책임자 : 포스텍 소속일 경우, 필수 선택

서비스 신청 방법 (4) - 첨부파일/ 요청 상세/ 업무 담당자 작성 및 선택

서비스 신청

 서비스 신청

Home > 웹서비스 신청 > 서비스 신청

첨부파일

전체 다운로드

전체 삭제

업로드

요청 상세

업무 담당자(선택)

업무 담당자

업무 담당자를 선택해주세요

초기화

- ① 첨부파일 : 첨부파일이 있는 경우 업로드
- ② 요청 상세 : 추가 요청 내용이 있는 경우 작성
- ③ 특정 업무 담당자에게 요청할 경우 선택
 - 예약할 장비 담당자 선택해주시면 됩니다.

서비스 신청 방법 (5) - 공정 절차 : 장비 선택

서비스 신청

서비스 신청

Home > 웹서비스 신청 > 서비스 신청

공정 절차

총 공정 수 : 0 예상금액 : 0원 총 공정 예상 소요 시간 : 분 (*공정 시간은 Fab 시설 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.)

단일공정

장비/공정추가

모두삭제

목록

저장

공정 신청

장비/공정추가

장비번호/장비명 SEM 공정그룹(대) 전체 Q 검색

공정번호/공정명

장비/공정 목록

공정그룹(대)	자동배정	장비상태	공정번호	공정명	선택
1	분석 및 기타	가동중	PT0512	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS	선택
2	분석 및 기타	가동중	PT0512	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS	선택
3	분석 및 기타	가동중	PT0511	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS	선택
4	분석 및 기타	가동중	PT0512	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS	선택
5	분석 및 기타	가동중	PT0510	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS	선택
6	분석 및 기타	가동중	PT0512	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS	선택

선택 목록 전체삭제

공정번호 삭제

10 Page 1 of 1 Displaying 1 to 6 of 6 items

저장

닫기

① 장비/ 공정 추가 버튼 선택

- 신청방식이 [본인설계]인 경우에만 이 버튼이 활성화 됩니다.
- 꼭 본인 설계로 진행해주세요. (P6 참고)

② 원하는 장비를 [장비번호/장비명]에 검색 후 선택

- 장비 별로 겹치는 공정 번호가 있으니 확인 후 예약 부탁드립니다.
- 공정 번호는 P10 참고해주세요.

③ 저장 선택

서비스 신청 방법 (5) - 장비 별 공정 코드

No.	장비 명	공정번호	담당자	공정 명
1	3D Conforcal Scanning Microscope (3DCSM)	PT0502	김정훈	비접촉 3D 형상측정
2	Atomic Force Microscope- II (Jupiter XR) / AFM- II	PT0756	한은영	특수모드 (PFM, KPFM, C-AFM, AMFM 등)
3	Atomic Force Microscope- II (Jupiter XR) / AFM- II	PT0755	한은영	미세탐침을 이용한 표면 형상 분석
4	Focused Ion Beam - I (Helios 600 with TKD) / FIB - I	PT0505	백경흠	3차원 가공 및 TEM 시료제작, 단면 관찰, 미세 집합조직 해석
5	Focused Ion Beam - II (Helios 650 with EBSD) / FIB - II	PT0754	이단비	3차원 가공 및 구조의 입체적 분석, 미세 집합조직 해석
6	Focused Ion Beam -III (Helios G3 CX) / FIB-III	PT0508	김성규	나노 정밀도 이온빔을 이용한 3차원 마이크로 단위 시료 제작 및 가공
7	Focused Ion Beam -IV (SMI 3050) / FIB-IV	PT0509	김정훈	3차원 가공 및 TEM 시료제작, 단면 관찰
8	High Resolution FE-SEM-I (JSM 7401F)	PT0512	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS
9	High Resolution FE-SEM- II (JSM 7800F PRIME with Dual EDS)	PT0512	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS
10	High Resolution FE-SEM- II (JSM 7800F PRIME with Dual EDS)	PT0511	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정 시 담당자와 사전협의 후 진행)
11	High Resolution FE-SEM-III (HITACHI S-4800)	PT0512	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS
12	High Resolution FE-SEM-III (HITACHI S-4800)	PT0510	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS
13	High Resolution FE-SEM-IV (JSM-IT710HR)	PT0512	한은영	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS
14	High Resolution Powder-XRD	PT0760	최혜원	분말 회절 분석 : 정성, 정량, 결정화도, 격자상수, 결정자 사이즈 / 격자변형평가 등 - 결정성 분말, 시료의 정성분석 및 결정구조 분석
15	HR-[S]TEM- I (2100F with Probe Cs-Corrector)	PT0514	김정훈	투과 전자 빔에 의한 나노 구조/성분분석 TEM/ STEM/ EDS/ BF/ HAADF
16	HR-[S]TEM - II (2200FS with Image Cs-corrector)	PT0513	박현진	나노구조/성분 분석(TEM/BF/DF/SAED/EF-TEM(EELS Mapping)/STEM/BF/HAADF/EDS)
17	Raman Spectroscopy	PT0817	한은영	Raman Spectroscopy (Spectrum/Mapping)
18	UV/Vis/nIR Spectrometer	PT0528	한은영	UV/Vis/nIR 측정

- 노란색으로 표시되어 있는 장비(SEM-1, 2, 3, 4)는 공정 번호 동일
- 장비 사용 시 공정 번호가 아닌 **장비명**을 검색
예) SEM-1 장비 예약 시, [7401] 검색

서비스 신청 방법 (6) - 공정 절차 : 진행방법/ 예약 시간 선택

서비스 신청

서비스 신청

Home > 웹서비스 신청 > 서비스 신청

공정 절차

총 공정 수 : 1 예산금액 : 100,000원 총 공정 예상 소요 시간 : 60분 (*공정 시간은 Fab 시설 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.)

단일공정 장비/공정추가 모두삭제

[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM-II 나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정.... (MAFS03 - PT0511)

공정그룹대: 분석 및 기타 담당자: 신혜연 진행방법: 장비 의뢰진행 수량: 1 예약시간: 2025-01-06 08:00 ~ 2025-01-06 09:00 예약변경

상세 요청 내용

작업중 체크 요소 입력 시 우측 저장 버튼을 클릭해야 해당 내용이 저장됩니다. 입력 예) 의뢰 시 공정운영자와의 업무 요청 체크

저장 추가 삭제

장비 의뢰진행

장비 의뢰진행

장비 직접사용

① 진행 방법] 장비 의뢰 진행 / 장비 직접 사용 선택

- 직접 사용 유저분이 장비 의뢰 진행으로 선택 시, 서비스 비용으로 청구 됩니다.
- 꼭 알맞은 진행 방법을 선택해주세요!

② 예약 변경

- **2시간 이상 예약을 하고 싶으신 분은 P19를 참고해주세요.**
- **공휴일 및 주말 예약이 안됩니다. (평일 야간 예약은 가능)**
- 공휴일 및 주말에 예약을 원하시는 분은 장비 담당자에게 문의해주시면 예약 도와드리겠습니다.

서비스 신청 방법 (7) - 공정 신청 완료

서비스 신청

 서비스 신청

Home > 웹서비스 신청 > 서비스 신청

총 공정 수 : 2 예상금액 : 200,000원 총 공정 예상 소요 시간 : 120분 (*공정 시간은 Fab 시설 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.)

단일공정 ▼ 장비/공정추가 모두삭제

1	[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM-II 나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정.... (MAFS03 - PT0511) • 공정그룹대: 분석 및 기타 담당자: 신혜연 진행방법: 장비 의뢰진행 ▼ 수량: 1 예약시간: 2025-01-15 09:00 ~ 2025-01-15 10:00 예약변경 상세 요청 내용 작업중 체크 요소 입력 시 우측 저장 버튼을 클릭해야 해당 내용이 저장됩니다. 입력 예)의뢰 시 공정운영자와의 업무 요청 체크	저장 추가 삭제
2	[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM-II 나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정.... (MAFS03 - PT0511) • 공정그룹대: 분석 및 기타 담당자: 신혜연 진행방법: 장비 의뢰진행 ▼ 수량: 1 예약시간: 2025-01-15 10:00 ~ 2025-01-15 11:00 예약변경 상세 요청 내용 작업중 체크 요소 입력 시 우측 저장 버튼을 클릭해야 해당 내용이 저장됩니다. 입력 예)의뢰 시 공정운영자와의 업무 요청 체크	저장 추가 삭제

목록

저장

공정 신청

자동 배정

[공정 신청] 버튼을 눌러 예약 완료

장비별 신청 방법

장비별 신청 방법 (1) - 장비 선택

장비별 신청

MOAFAB
국가 나노랩 서비스 한 곳에 모아!

팹서비스 소개 ▾ 팹서비스 신청 ▾ 팹서비스 현황 ▾ 고객센터 ▾

로그아웃 마이페이지 운영 메뉴

KION
국가나노인프라협약체

장비별 신청

Home > 팹서비스 신청 > 장비별 신청

전체 ▾ 장비명을 입력하세요 🔍

대상기관

☒ 나노융합기술원 ☐ 한국나노기술원 ☐ 대구경북과학기술원 ☐ 서울대학교 반도체공동연구소 ☐ 한국전자통신연구원

분류

전체 에피공정 산화공정 포토리소그래피 식각공정 증착공정 배선공정 EDS 패키징 분석 및 기타

총 93개

목록

타일

분류	장비명	한글명	보유기관	모델명	담당자	상태	예약
분석 및 기타	Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS)	2차이온질량분석기	나노융합기술원	IMS 6F	김성규	가동중	신청
식각공정	3D Profiler	3차원 프로파일러	나노융합기술원	Wyko NT1100	김병욱	가동중	신청
증착공정	4 Point Probe - 1	4단 면저항 측정기-1	나노융합기술원	CMT-SR2000N	김동은	가동중	신청

① 나노융합기술원 선택

② 원하는 장비 선택

장비별 신청 방법 (1) - 장비 선택

장비별 신청

공정 선택

공정명

Q 검색

장비/공정 목록

	☐	장비번호	장비명	공정그룹(대)	공정그룹(중)	공정코드	공정명
1	☒	MAFS03	전계 방출형 주사전자현미경	분석 및 기타	분석	PT0512	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 E
2	☐	MAFS03	전계 방출형 주사전자현미경	분석 및 기타	분석	PT0511	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 S

10

Page 1 of 1

Displaying 1 to 2 of 2 items

☒ 선택

☐ 닫기

③ 원하는 분석 선택

- 공정명이 잘려서 보인다면, P10 장비별 코드 참고바랍니다.

장비별 신청 방법 (2) - 신청정보 작성

장비별 신청

 서비스 신청

Home > 펌서비스 신청 > 서비스 신청

신청 정보

신청번호		서비스 상태	
분석 신청명 *	신청명은 실험 과제명 혹은 결과물(제품)등으로 명명하거나 혹은 다르게 명명하더라도 명확하게 분류할 수 있도록 명명하여 등록하기를 권합니다.		
지원 사업 *	일반 서비스		
시료 수탁예정일 *	2025-02-18	이용목적 *	선택
신청분야 *	선택	공정분야 *	선택
신청방식 *	본인 설계	진행방법 *	장비 직접사용

① 공정분야

- [단일 공정] 선택해주세요.

② 신청 방식

- 기관설계 : 공정/장비 및 순서를 모두 기관에게 의뢰
- **본인설계 : 공정/장비 및 순서를 신청자가 직접 설계**

** 분석 장비를 사용을 원하시는 분들은 **본인 설계**로 신청해주세요.
본인 설계로 진행 해야지 장비 선택이 가능합니다.

선택

선택

단일공정

모듈공정

일괄공정

장비별 신청 방법 (3) - 공정 절차 확인

장비별 신청

i 공정 절차

총 공정 수 : 1 예상금액 : 0원 총 공정 예상 소요 시간 : 분 (*공정 시간은 FAB 시설 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.)

1	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정시 담당자와 사전협의 후 진행) (MAFS03 - PT0511)
---	--

목록

저장

③ 공정 절차

- 서비스 신청 방법과 다르게 공정 절차 부분에 예약 시간 및 직접 사용/ 서비스 선택하는 버튼이 활성화되어 있지 않습니다.
- 이 부분도 아래쪽 [저장] 버튼을 눌러 주시면 활성화 됩니다.

이후, 서비스 신청 방법과 동일하게 작성해주시면 됩니다.

두 시간 이상 예약 방법

두 시간 이상 예약 방법 (1) - 예약 변경 선택

 서비스 신청

Home > 팹서비스 신청 > 서비스 신청

공정 절차

총 공정 수 : 1 예상금액 : 100,000원 총 공정 예상 소요 시간 : 60분 (*공정 시간은 Fab 시설 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.)

단일공정 ▼ 장비/공정추가 모두삭제

↑ ↓	1	[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM- II 나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS (MAFS03 - PT0512)			 저장  추가  삭제
		공정그룹대: 분석 및 기타 담당자: 신혜연 진행방법: 장비 직접사용 ▼ 수량: 1 예약시간: ~	예약변경		
상세 요청 내용 작업중 체크 요소 입력 시 우측 저장 버튼을 클릭해야 해당 내용이 저장됩니다. 입력 예)의뢰 시 공정운영자와의 업무 요청 체크					

예약 변경 선택

두 시간 이상 예약 방법 (2) - 반복 횟수 선택

시간 변경

• 기준시간 60 (분)

• 반복횟수 2

• 시작

• 종료 Invalid date

장비예약시간 조회

2025.02

일	월	화	수	목	금	토
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

시

	9am	10am	11am	12pm	1pm	2pm	3pm	4pm	5pm	6pm	7p
00											
30											

현재 예약 구간

예약불가

확인

닫기

- 반복 횟수 선택

- [반복 회수 = 분석 시간] 입니다.
- 두 시간을 원하신다면 반복 회수 2를 선택해주시면 됩니다.

두 시간 이상 예약 방법 (3) - 시작 시간 설정

시간 변경

• 기준시간 60 (분)

• 반복횟수 2 ▼

• 시작 2025-02-27 21:00

• 종료 2025-02-27 23:00

장비예약시간 조회

2025.02 >

일	월	화	수	목	금	토
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

시

pm	1pm	2pm	3pm	4pm	5pm	6pm	7pm	8pm	9pm	10pm
00										
30										

○ 현재 예약 구간 ■ 예약불가

✓ 확인

✕ 닫기

- 시작 시간을 설정해주시면, 종료 시간도 함께 설정됩니다.

예약 승인 확인 방법

예약 승인 확인 방법 (1) - 서비스 모니터링



서비스 모니터링 선택

예약 승인 확인 방법 (2)

서비스 모니터링

Home > 랩서비스 현황 > 서비스 모니터링

서비스 모니터링

검색기간 2024-09-18 ~ 2025-02-18

랩서비스

신청 1 건

진행 0 건

완료 0 건

상담 현황

진행 0 건

완료 0 건

정산 현황

정산 미납 건 수 0 건

공정신청

시험/분석

(N) TEST(250218) (S2502180081)

01 신청

02 검토

03 진행

04 완료

05 정산

06 결과확인

07 설문

설문조사 참여

순번	공정명	장비명	공정예약일시	공정진행일시	공정상태	진행 담당자
1	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS	[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM- II	(신청) 2025-02-18 ~ 2025-02-18	~	승인대기	

(N) TEST(250218) (S2502180081)

01 신청

02 검토

03 진행

04 완료

05 정산

06 결과확인

07 설문

설문조사 참여

순번	공정명	장비명	공정예약일시	공정진행일시	공정상태	진행 담당자
1	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS	[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM- II	(승인) 2025-02-18 ~ 2025-02-18	~	승인대기	신혜연

(신청) 에서 (승인)으로 바뀌면 예약 승인 된 것입니다.

예약 취소 방법

예약 취소 방법 (1) - 서비스 현황



서비스 현황 선택

예약 취소 방법 (2)

서비스 현황

Home > 팜서비스 현황 > 서비스 현황

서비스 현황

전체

모니터링

기관	신청번호 (기관신청번호)	신청명	공정그룹(대)	공정 장비수	신청방식	서비스 예약일자	서비스 상태 (기관신청상태)	상세
나노융합기술원	S2502190115	(N) TEST(250219)	분석 및 기타	1	본인 설계	2025-02-20 ~ 2025-02-20	신청	상세 취소
나노융합기술원	S2502190112	(N) TEST(250219)	분석 및 기타	1	본인 설계	2025-02-20 ~ 2025-02-20	신청	상세
나노융합기술원	S2502180081	(N) TEST(250218)	분석 및 기타	1	본인 설계	[미지정]	요청반려	수정
나노융합기술원		1	분석 및 기타	1	본인 설계	2025-01-06 ~ 2025-01-06	작성중	수정 삭제

1. 취소 및 삭제 버튼이 활성화 O : 해당 버튼을 눌러 주시면 취소 됩니다.
2. 취소 및 삭제 버튼이 활성화 X : 장비 담당자에게 문의 주세요.
3. 취소 확인 방법 : 서비스 상태가 [요청 반려]가 되었다면, 취소된 것입니다.

장비별 예약 확인 방법

장비별 예약 확인 방법 (1) - 장비별 신청에서 장비 선택



국가 나노랩 서비스 한 곳에 모아!

팹서비스 소개

팹서비스 신청

팹서비스 현황

고객센터

로그아웃

마이페이지

운영

메뉴



국가나노원프라임의제

사이트 이용방법

팹서비스 절차

상담 신청

견적 신청

서비스 신청

장비별 신청

상담 현황

견적 현황

서비스 현황

서비스 모니터링

정산 현황

공지

보도자료

문의

FAQ

시스템개선

① 장비별 신청 선택

전체

7800

대상기관

☐ 나노융합기술원 ☐ 나노종합기술원 ☐ 한국나노기술원 ☐ 대구경북과학기술원 ☐ 서울대학교 반도체공동연구소 ☐ 한국전자통신연구원

분류

전체

에피공정

산화공정

포토리소그래피

식각공정

증착공정

배선공정

EDS

패키징

분석 및 기타

총 3개

목록

타일

분류	장비명	한글명	보유기관	모델명	담당자	상태	예약
분석 및 기타	JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM- II	전계 방출형 주사전자현미경	나노융합기술원	JSM-7800F Prime	신혜연	가동중	신청

② 원하는 장비의 장비명 선택

시험분석결과서 발급 방법

시험분석결과서 발급 방법 (1) - 정산 현황 선택



정산 현황 선택 후 증명서 발급

이 외 궁금한 점이 있다면,
장비 담당자에게 연락 바랍니다.